



سیستم کامل لایه نشانی و زدایش مجهر به چشمہ یون، تفک الکترونی، منبع تبخیر حرارتی و کاتداسپاترینگ مدل‌های IDS و ITS

• کاربردها

- ساخت نیمه‌هادی‌ها
- ساخت مدارات مجتمع
- فوتونیک و اپتوالکترونیک
- ساخت لایه‌های اپتیکی دقیق
- ساخت لایه‌های محافظ در برابر سایش و خوردگی
- ساخت لایه‌های کاربردی در ادوات ذخیره‌سازی داده



• مشخصات دستگاه

- دارای صفحه کار و درب مستقل
- فشار نهایی: محدوده 10^{-9} میلی بار
- حجم محافظه فرآیند: تقریباً ۱۱۰ لیتر
- جنس محافظه فرآیند: استیل ضدزنگ
- ابعاد دهانه پمپ اصلی: ISO-K160
- نوع عملکرد: نیمه اتوماتیک با انواع حفاظت‌ها
- نحوه جابه‌جایی محافظه: بالابر الکتروپیونماتیک

نوع عملکرد چشمہ یون	سیستم تخلیه	مدل
جریان مستقیم (DC)	پمپ مکانیکی و پمپ دیفیوژن، شیر پروانه‌ای و تله ازت مایع	IDS/DC-I160
جریان متناوب (RF)	پمپ مکانیکی و پمپ دیفیوژن، شیر پروانه‌ای و تله ازت مایع	IDS/RF-I160
جریان مستقیم (DC)	پمپ مکانیکی و پمپ توربومولکولار	ITS/DC-I160
جریان متناوب (RF)	پمپ مکانیکی و پمپ توربومولکولار	ITS/RF-I160

• تجهیزات نصب شده روی دستگاه



- چشمہ پرتو پهنه یون
- منبع تبخیر پرتو الکترونی با توان ۳ کیلووات
- کاتد مگنترون اسپاترینگ (دو یا سه اینچ) جریان مستقیم
- منبع تبخیر مقاومتی با حداکثر جریان ۲۵۰ آمپر
- ضخامت‌سنج کریستالی کامپیوترا
- نگهدارنده نمونه چرخان
- گرم کن نمونه تابشی با کنترلر دما

• مزایای چشمه‌های یون در مقایسه با روش‌های لایه‌نشانی دیگر

- کنترل نوع یون (جرم و بار یون)
- کنترل مستقل چگالی و انرژی یون
- تولید چند لایه‌ای‌ها بدون شکستن خلا
- کنترل راستای فرود یون نسبت به سطح هدف یا زیرآیند
- جدا بودن فرآیند تولید یون از فرآیند مربوط به هدف یا زیرآیند